

В. М. Теслюк, к.т.н., доцент кафедри САП, НУ «Львівська політехніка»,  
Р. В. Загарюк, аспірант НУ «Львівська політехніка»,  
Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі, аспірант НУ «Львівська політехніка»,  
М. Р. Мельник, аспірант НУ «Львівська політехніка».

## **ПОБУДОВА VHDL-AMS МОДЕЛІ АКСЕЛЕРОМЕТРА ЄМНІСНОГО ТИПУ З ВРАХУВАННЯМ ЖОРСТКОСТІ ПРУЖИН**

В роботі побудовано VHDL-AMS модель ємнісного акселерометра, що враховує жорсткість пружин з допомогою яких інерційна маса кріпиться до основи, що забезпечує підвищення точності моделі. Наведено результати тестування VHDL-AMS моделі.

In this work it is built VHDL-AMS model of capacitive accelerometer, which counts a inflexibility of springs by which inertia mass is fixing to the basis, which provides the raise of model exactness. Results of testing the VHDL-AMS model is illustrated.

### **Вступ**

За останні роки індустрія мікроелектроніки активно розвивається як у напрямку мініатюризації мікроелектронних пристроїв, так і у напрямку інтеграції в єдине ціле різних за фізичними принципами дії функціональних пристроїв. Називають такі інтегральні пристрої – мікроелектромеханічні системи (MEMS)[1 - 3]. Процес розроблення таких мікросистем відбувається з використанням досвіду, знань, технічних прийомів та методів з різних галузей науки і техніки. Це в свою чергу зумовлює необхідність функціональної інтеграції різномірних комп'ютерних систем або розробки принципово нових інформаційних технологій аналізу та синтезу MEMS. Центральне місце таких інформаційних технологій займає математичне забезпечення, яке описує процеси з різних областей науки та техніки.

В більшості випадків для розроблення нових мікросистем використовують багаторівневе ієрархічне проектування, яке передбачає виконання проектних процедур на системному, функціональному, компонентному та елементному рівнях [4].

*Проведений аналіз існуючого математичного забезпечення для схемотехнічного рівня показав, що ці моделі володіють низькою точністю [5 - 7]. Тому робота присвячена розробці VHDL-AMS – моделі ємнісного акселерометра для схемотехнічного рівня проектування із врахуванням жорсткості пружин для підвищення точності вихідних результатів – є актуальною.*

© В. М. Теслюк, Р. В. Загарюк, Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі,  
М. Р. Мельник

### 1. Модель для врахування жорсткості пружини акселерометра ємнісного типу

Приклад конструкції ємнісного акселерометра зображено на рис.1. У зв'язку з нееластичністю рухомої маси, модель жорсткості акселерометрів цього типу визначає U-жорсткість. В цьому випадку ефективну жорсткість U-пружин визначаємо за допомогою енергетичного методу. В цьому методі сила F (або момент M) прикладається до вільного кінця пружини в визначеному напрямі. Зміщення  $\delta$  визначається на основі другої теореми Кастіліано. Константа жорсткості визначається з виразу  $k = \frac{F}{\delta}$ .

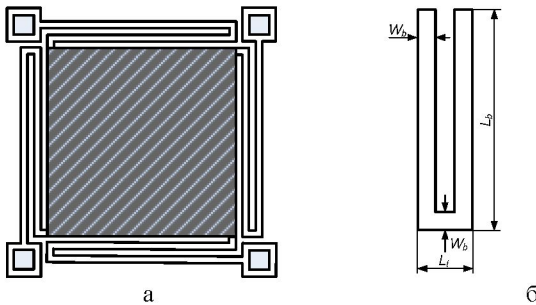


Рис.1. а) базова конструкція ємнісного акселерометра, б) конструкція пружини

Враховуючи зміщення тільки від згину та кручення, загальна енергія напруження U лінійної структури визначається з виразу:

$$U = \sum_{i=1}^N \int_0^{L_i} \frac{Mi(\xi)^2}{2 * E * I_i} d\xi, \quad (1)$$

де E – модуль Юнга для матеріалу пружини,  $L_i$  – довжина i-ої пружної балки в пружині,  $Mi(\xi)$  – момент кручення вздовж пружної балки i, і  $\xi$  – відстань з кінця пружини. Момент кручення  $Mi$  визначається з сил і моментів, які прикладаються до кінця пружини.

З другої теореми Кастіліано, частинна похідна енергії напруження U від прикладеної сили  $F_j$  рівна зміщенню від заданої сили,  $\delta_j$ .

$$\delta_j = \frac{\partial U}{\partial F_j}. \quad (2)$$

Відповідно, кутові зміщення  $\Theta_j$ , отримані з прикладених моментів,  $M_j$  визначаються як:

$$\Theta_j = \frac{\partial U}{\partial M_j}. \quad (3)$$

Після розв'язання системи рівнянь з енергетичного методу, жорсткість пружини вздовж осі X є:

$$k_x = \frac{12 * \alpha * E * I_b}{L_t^2 (6 * \alpha * L_b + L_t)}, \quad (4)$$

де  $E$  – модуль Юнга для полікремнію,  $L_b$  та  $L_t$  – довжини горизонтальних та вертикальних пружних балок відповідно;  $W_t$  та  $W_b$  – відповідні їх ширини;  $I_b$  – момент кручення балки  $b1$  та  $b2$ .

$$I_b = \frac{t * W_b^3}{12}, \quad \alpha = \left( \frac{W_t}{W_b} \right)^3. \quad (6)$$

За схожим принципом можна визначити жорсткість вздовж осі  $y$ :

$$k_y = \frac{3 * E * I_b (2 * \alpha * L_b + L_t)}{L_b^3 (\alpha * L_b + 2 * L_t)}. \quad (7)$$

Повна форма  $k_\theta$  для спрощеного випадку ( $W_t = W_b, L_{b1} = L_{b2} = L_b$ ) є:

$$k_\theta = \frac{E * I_b [12 * L_{p2}^2 * L_b^2 + 12 * L_{p2} * L_b^2 * L_t + L_t^2 (36 * L_b * W_{p2} + 36 * W_{p2}^2 + 15 * L_b^2)]}{6 * L_b^3 * L_t^2},$$

де  $L_{p2}$  і  $W_{p2}$  є половина довжини та ширини рухомої маси відповідно.

Робота наведеної вище спрощеної моделі описується диференціальним рівнянням другого порядку [8, 9]

$$m \frac{d^2 X}{dt^2} + b \frac{dX}{dt} + kX = F, \quad F = F_a + F_{el}, \quad (8)$$

де  $X$  - зміщення;  $F_a$  - механічна сила;  $F_{el}$  - сила, обумовлена електростатичним полем;  $m$  - сейсмична маса;  $k$  – коефіцієнт пружності пружини;  $b$  – коефіцієнт демпфірування.

Для визначення ємності акселерометра використано наступну формулу [10]  $C_o = \epsilon_o \epsilon \frac{A}{d}$ , де  $\epsilon$  - діелектрична проникність речовини між пластинами мікрофона;  $\epsilon_o$  - діелектрична проникність вакууму;  $A$  – площа мембрани;  $d$  – відстань між пластинами.

Для визначення змін вихідного струму використано наступний вираз:

$$i = \frac{\partial Q}{\partial t}, \quad Q = CU, \quad (9)$$

де  $U$  - прикладена напруга,  $Q$  - накопичений на конденсаторі заряд.

## 2. Побудова VHDL-AMS модель ємнічного акселерометра

Приклад розробленої VHDL-AMS моделі наведено на рис.2, а результати зміни ємності від прикладеної сили на рис. 3.

```

----- Module ACCEL_COMB1 -----
library Disciplines; use Tutorial.extra_functions.all;
use Disciplines.electrical_system.all;
entity ACCEL_COMB1 is
generic ( E:real:=126000000000;
         Lb:real:=0.000413;
           Lt:real:=0.000044;
           Wt:real:=0.0000045;
           Wb:real:=0.000005;
           t:real:=0.0000008;
           M : real := 1.2e-7;
           D : real := 4.0e-6;
           K : real := 2.6455;
           eps : real := 1.0006;
           epsVak:real:=8.85419e-12;
           Area : real := 1.0e-6;
           d : real := 5.0e-5;
           Volt : real := 10.0 );
port ( terminal Fin : electrical );
end entity ACCEL_COMB1;
architecture archACCEL_COMB1 of ACCEL_COMB1 is
    quantity x : real := 0.0;
        quantity R : real := 0.0;
        quantity V : real := 0.0;
        quantity F across Fin to GROUND;
        quantity C1 : real := 0.0;
quantity Q1 : real := 0.0;
quantity I1 : real := 0.0;
quantity alfa:real:=0;
quantity Kx:real:=0;
quantity Ib:real:=0;
begin
    alfa==(Wt/Wb)*(Wt/Wb)*(Wt/Wb);
    Ib==((t*Wb*Wb*Wb)/12);
    Kx==(12*alfa*E*Ib)/(Lt*Lt*(6*alfa*Lb+Lt));
    V'dot == (F-R)/M;
    R == D*V+Kx*x;
    x'dot == V;
    C1 == Area*eps*epsVak/(d-x);
    Q1 == C1*Volt;
    Q1'dot == I1;
end architecture archACCEL_COMB1;

```

Рис.2. Побудована VHDL-AMS модель ємнісного акселерометра

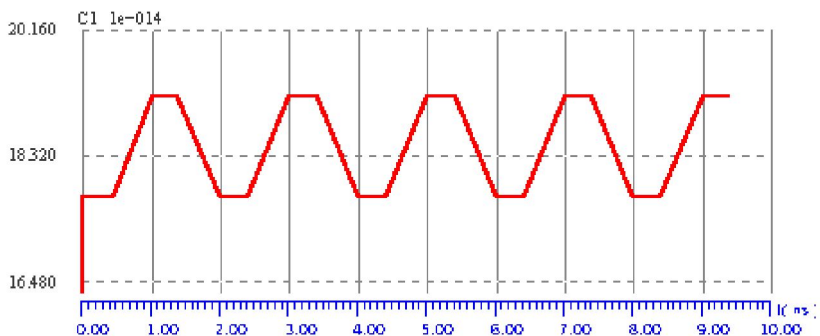


Рис. 3. Результати аналізу зміни електричної ємності

## ВИСНОВКИ

Розроблено VHDL-AMS модель акселерометра ємнісного типу для схемотехнічного рівня проектування, яка враховує жорсткість пружин відносно осей X та Y, та проведено аналіз результатів її роботи. Запропонована модель дає змогу підвищити точність вихідних результатів на схемотехнічному рівні.

1. *Теслюк В.М.* Моделі та інформаційні технології синтезу мікроелектромеханічних систем: Монографія. – Львів: Видавництво ПП "Вежа і Ко", 2008 – 192 с.
2. *Лучинин В.В.* Микросистемная техника. Направления и тенденции развития // Научное приборостроение. 1999. Т. 9. № 1. С. 3-18.
3. *Лысенко И.Е.* Проектирование сенсорных и актюаторных элементов микросистемной техники. – Таганрог: Изд-во ТРГУ. 2005. – 103 с.
4. *Норенков И.П.* Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 336 с.
5. *Bernhard E. Boser* Capacitive Interfaces for Monolithic Integrated Sensors, Chapter in "RF Analog-to-Digital Converters; Sensor and Actuator Interfaces; Low-Noise Oscillators, PLLs and Synthesizers," Kluwer Academic Publishers, November 1997.
6. *Varadan V.K. and Varadan V.V.* Microelectro- mechanical Systems (MEMS), 2000.
7. *Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Тарік (Мох'д Тайсір) Алі Аль Омарі, Бобало С.І.* Розробка vhdl-ams моделі ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - Львів, 2008. – № 626. – С. 110 - 115.
8. *Teslyuk V., Zaharyuk R.* Model of capacitive microaccelerometer / Perspective technologies and methods in MEMS design : Proc. of the II-d intern. conf. of young scientists. – Lviv-Polyana, 2006. – P. 86.
9. *Молчанов И. Н.* Машинные методы решения прикладных задач. Дифференциальные уравнения. – К. : Наукова думка, 1988. – 344 с.
10. *Тамм И.Е.* Основы теории электричества: Учеб. Пособие для вузов.-10-е изд., испр.- М.: Наука. Гл. Ред. Физ.-мат. Лит., 1989. – 504 с.

Поступила 11.02.2009р.